ISSN 2078-5615. Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2016. Випуск 57. Ч. 1. С. 155–162 Visnyk of the Lviv University. Series Chemistry. 2016. Issue 57. Pt. 1. P. 155–162

УДК 548.736.4

## ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ Нf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn. I. ДОСЛІДЖЕННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУР

Ю. Стадник<sup>1</sup>, Л. Ромака<sup>1</sup>, В. В. Ромака<sup>2</sup>, В. Крайовський<sup>2</sup>, О. Гук<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів, Україна

<sup>2</sup>Національний університет "Львівська політехніка", вул. С. Бандери, 12, 79013 Львів, Україна

<sup>3</sup>ПАТ НВО "Термоприлад", вул. Наукова, 3, 79060 Львів, Україна, e-mail: stadnyk\_yuriyl@franko.lviv.ua

Досліджено кристалографічні характеристики, електронну структуру, область існування та магнітну сприйнятливість напівпровідникового твердого розчину  $H_{1-x}Y_xNiSn$  (структурний тип MgAgAs). Виявлено механізми генерування у кристалографічній позиції атомів Hf (4*a*) структурних дефектів акцепторної природи внаслідок зайняття її атомами Y. Проаналізовано можливі механізми електропровідності твердого розчину  $H_{1-x}Y_xNiSn$  залежно від концентрації атомів Y.

*Ключові слова*: твердий розчин, кристалічна структура, електронна структура, напівпровідник.

У ході вивчення впливу сильного легування напівпровідників зі структурою типу MgAgAs (*n*-ZrNiSn, *n*-TiNiSn, *n*-HfNiSn, *p*-TiCoSb) на зміну структурних, енергетичних, кінетичних та магнітних характеристик досліджено твердий розчин  $Hf_{1-x}Y_xNiSn$ , отриманий легуванням *n*-HfNiSn атомами Y. Ці дослідження зумовлені тим, що оптимізація параметрів термоелектричних (термометричних) матеріалів залежить від низки чинників, зокрема, концентрації та просторової орієнтації носіїв заряду, механізмів розсіювання, теплопровідності тощо, а одним зі способів такої оптимізації є легування напівпровідникового матеріалу донорними і/або акцепторними домішками [1].

Зразки синтезовано методом електродугового сплавлення компонентів з подальшим гомогенізувальним відпалюванням при 1070 К упродовж 720 год. Для синтезованих зразків досліджували кристалографічні характеристики, область існування, магнітну сприйнятливість ( $H \le 10$  кГс) та розраховували розподіл електронної густини (DOS) твердого розчину Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn. Хімічний та фазовий склади зразків контролювали за допомогою мікрозондового аналізатора (електронний мікроскоп Carl Zeiss DSM 962).

<sup>©</sup> Стадник Ю., Ромака Л., Ромака В. В. та ін., 2016

Для розрахунків структурних характеристик використовували масиви даних, отримані методом порошку (дифрактометр Guinier-Huber image plate system, CuKa<sub>1</sub>випромінювання;  $8^{\circ} \le 2\theta \le 100^{\circ}$ ). Кристалографічні параметри розраховували з використанням програми WinPLOTR [2]. Розрахунки електронної структури проводили методами Корінги–Кона–Ростокера (KKR) у наближенні когерентного потенціалу (CPA) і локальної густини (LDA) [3]. Для розрахунків використовували значення сталої гратки на *k*-сітці розміром  $10 \times 10 \times 10$  і тип параметризації обмінно-кореляційного потенціалу Moruzzi–Janak–Williams [4]. Ширина енергетичного вікна, охоплюваного контуром, становить 16 еВ. Кількість значень енергії для розрахунку DOS становила 1000. Точність розрахунку положення рівня Фермі – ±8 меВ.

Рентгенівські фазовий і структурний аналізи засвідчили, що синтезовані зразки  $Hf_{1,x}Y_xNiSn$  до складу x = 0,30 включно не містять слідів інших фаз. Рентгеноспектральний аналіз зразків  $Hf_{1,x}Y_xNiSn$  до x = 0,30 довів їхню відповідність вихідним складам шихти (рис. 1, *a*), що є одним з експериментальних доказів прогнозованого заміщення атомів Hf на Y. Зразок  $Hf_{1,x}Y_xNiSn$  за вмісту Y x = 0,35 як домішкову фазу містить сполуку YNiSn (структурний тип TiNiSi) (див. рис. 1,  $\sigma$ ).



Рис. 1. Фотографії мікроструктур зразків:  $a - Hf_{0,70}Y_{0,30}NiSn (Hf_{22,97}Y_{9,74}Ni_{34,03}Sn_{33,26});$  $\delta - Hf_{0,65}Y_{0,35}NiSn$  (cipe dece Hf V NiSp (Uf V Ni Sp )); точча dece VNiSp)

(сіра фаза  $Hf_{1-x}Y_xNiSn$  ( $Hf_{19,27}Y_{11,36}Ni_{36,52}Sn_{32,75}$ ); темна фаза YNiSn).

Як і очікували, заміщення атомів меншого розміру Hf ( $r_{\rm Hf} = 0,158$  нм) більшими атомами Y ( $r_{\rm Y} = 0,180$  нм) приводить до збільшення значень періоду елементарної комірки Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn (рис. 2). Той факт, що значення a(x) в інтервалі концентрацій Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn x = 0-0,30 практично збігаються з одержаними за розрахунками електронної структури, свідчить про реалізацію твердого розчину заміщення. Відхилення значень

періоду елементарної комірки a(x) від лінійної залежності при x > 0,30 фіксує межу існування твердого розчину  $Hf_{1,x}Y_xNiSn$ .

Дослідження також підтвердили результат [5] стосовно невпорядкованості кристалічної структури *n*-HfNiSn, суть якої полягає у частковому, до ~1 %, зайнятті атомами Ni  $(3d^84s^2)$  кристалографічної позиції 4*a* атомів Hf  $(5d^26s^2)$ , що породжує у кристалі структурні дефекти донорної природи, а електрони є основними носіями електрики.

Уточнення кристалічної структури  $Hf_{1-x}Y_xNiSn$  методом порошку з одночасним уточненням ізотропних параметрів атомного заміщення та зайнятості кристалографічної позиції Hf (4*a*) засвідчило, що найменше значення коефіцієнта невідповідності моделі кристалічної структури та масиву брегівських відбиттів ( $R_{Br} = 2,8\%$ ) отримано для моделі, у якій зайнятість позиції атомів Hf(Y) для  $x \ge 0,01$ , становить 100 %. Отже, уведені у структуру атоми Y упорядковують кристалічну структуру Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn, що створює передумови для отримання матеріалу з однозначними та прогнозованими термоелектричними характеристиками.



Рис. 2. Розрахована та експериментально отримана зміна значень періоду елементарної комірки a(x) Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn.

Процес упорядкування кристалічної структури напівпровідника під час легування атомами Y, окрім структурних особливостей, робить суттєвий внесок у перерозподіл електронної густини. Якщо у вихідній сполуці HfNiSn існують структурні дефекти донорної природи як наслідок витіснення до ~1% атомів Hf атомами меншого розміру Ni [5], то процес легування напівпровідника атомами Y й упорядкування його кристалічної структури супроводжується, з одного боку, зменшенням кількості структурних дефектів донорної природи, оскільки атоми Ni покидають позицію атомів Hf ("заліковування" структурних дефектів донорної природи у позиції 4*a*). З іншого боку, оскільки атом Y (4*d*<sup>1</sup>5*s*<sup>2</sup>) має на один *d*-електрон менше, ніж атом Hf, то таке легування генеруватиме у кристалі структурні дефекти акцепторної природи.

	Ю. Стадник, Л. Ромака, В. В. Ромака та ін.
ISSN 2078-5615. Вісник Львівського унівек	ситету. Серія хімічна. 2016. Випуск 57. Ч. 1

Для прогнозування поведінки рівня Фермі  $\varepsilon_F$ , ширини забороненої зони  $\varepsilon_g$  та кінетичних характеристик Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn проведено розрахунок густини електронних станів (DOS) (рис. 3). З огляду на результати структурних досліджень, згідно з якими уведення у сполуку HfNiSn атомів Y упорядковує її кристалічну структуру, розрахунок DOS проведено для випадку впорядкованого варіанта структури.

Як зазначено вище, уведення атомів Y у структуру сполуки HfNiSn супроводжується генеруванням акцепторів, тому легування напівпровідника *n*-HfNiSn електронного типу провідності найменшими концентраціями акцепторної домішки очікувано супроводжуватиметься збільшенням ступеня компенсації напівпровідника.



Рис. 3. Розрахунок густини електронних станів DOS  $Hf_{1-x}Y_xNiSn$ .

Як показано на рис. 3, у разі введення в *n*-HfNiSn найменш досяжних в експерименті концентрацій акцепторної домішки Y рівень Фермі  $\varepsilon_F$  починає дрейфувати від зони провідності ( $\varepsilon_C$ ), на відстані ~81,3 меВ від якої він розташовувався [5], до середини забороненої зони  $\varepsilon_g$  (заштрихована ділянка на рис. 3), а далі до валентної зони ( $\varepsilon_V$ ), яку перетне за певних концентрацій Y. У випадку перетину рівнем Фермі  $\varepsilon_F$  середини забороненої зони ( $x \approx 0,02$ ) і подальшого руху в напрямі валентної зони зміниться тип провідності напівпровідника, а основними носіями струму стануть дірки. Подальше легування напівпровідника тепер діркового типу провідності акцепторами повинно супроводжуватися зменшенням ступеня компенсації. За концентрації Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn  $x \approx 0,05$  рівень Фермі  $\varepsilon_F$  перетне валентну зону і тепер зі збільшенням концентрації атомів Y дрейфуватиме по зоні неперервних енергій. У цьому разі зміниться механізм електропровідності. За концентрацій Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn  $x \approx 0,05$  сосновним механізмом електропровідності є активація дірок з домішкового акцепторного рівня у валентну зону, при  $x \ge 0,05$  активація дірок припиниться, оскільки рівень Фермі зайде у валентну зону: відбудеться перехід провідності діелектрик–метал [1].

Ю. Стадник, Л. Р	омака, В. В. Ромака та iн.	
ISSN 2078-5615		

Окрім дрейфу рівня Фермі, зумовленого зміною ступеня компенсації напівпровідника, також зафіксовано і зменшення значень ширини забороненої зони  $\varepsilon_g$  від значень  $\varepsilon_g$  (x = 0) = 514,3 меВ до  $\varepsilon_g$  (x = 0,10) = 431,8 меВ. Прогнозована поведінка рівня Фермі  $\varepsilon_F$  супроводжується цікавими процесами зміни значень густини станів на рівні Фермі (див. рис. 3). Легування напівпровідника електронного типу провідності *n*-HfNiSn акцепторними домішками Y очікувано приводить до зменшенням густини станів на рівні Фермі, а мінімум залежності  $g(\varepsilon_F)$  відповідає перетину рівнем Фермі середини забороненої зони напівпровідника. За концентрацій домішки Y, коли рівень Фермі перетне середину забороненої зони і наближатиметься до валентної зони, густина станів на рівні Фермі почне прогнозовано зростати.

159

Наведені результати розрахунків зміни розподілу електронної густини і, зокрема, густини станів на рівні Фермі узгоджуються з результатами експериментальних вимірювань магнітної сприйнятливості  $\chi$  Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn (рис. 4, *a*). Дослідження засвідчили, що зразки Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn, x > 0,01, є парамагнетиками Паулі, у яких магнітна сприйнятливість визначена винятково електронним газом і є пропорційною до густини станів на рівні Фермі.



Рис. 4. Зміна значень магнітної сприйнятливості  $\chi$  (крива 1) (*a*) та коефіцієнта термо-е.р.с.  $\alpha$  (розрахунок) ( $\delta$ ) Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn за температур: 1 – 80 K; 2 – 160 K; 3 – 250 K; 4 – 380 K.

Як показано на рис. 4, *a*, залежність  $\chi(x)$  на ділянці концентрацій x = 0,01-0,05 змінюється з найбільшою швидкістю, що пов'язано, як засвідчують розрахунки, зі зміною густини станів на рівні Фермі DOS  $\varepsilon_F$ . У цьому контексті зазначимо, що базовий напівпровідник *n*-HfNiSn є не парамагнетиком Паулі, а слабким діамагнетиком, про що свідчать від'ємні значення магнітної сприйнятливості:  $\chi(x = 0) = -0,082 \cdot 10^{-6} \text{ см}^3/\text{г}$ . Тому збільшення густини станів на рівні Фермі не є причиною незначного зростання залежності  $\chi(x)$  на ділянці концентрацій x = 0-0,01. Зміна нахилу залежності  $\chi(x)$  при  $x \ge 0,05$  пов'язана із входженням рівня Фермі у валентну зону.

На підставі розрахунку електронної структури термоелектричних матеріалів  $Hf_{1.x}Y_xNiSn$ , отримано механізм прогнозування кінетичних характеристик напівпровідника, зокрема, коефіцієнта термо-е.р.с., питомого електроопору тощо. Для розрахунку коефіцієнта термо-е.р.с.  $\alpha$  як робочу формулу використано співвідношення [6]

$$\alpha = \frac{2\pi^2}{3} \frac{k^2 T}{e} \left( \frac{d}{d\varepsilon} \ln g(\varepsilon_F) \right) ,$$

де  $g(\varepsilon_F)$  – густина станів на рівні Фермі. На рис. 4,  $\delta$ , як приклад, показано зміну значень коефіцієнта термо-е.р.с.  $\alpha(\omega)$  Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn за різних температур. Змінюючи концентрацію атомів Y, можна цілеспрямовано отримати в термоелектричному матеріалі високі як додатні, так і від'ємні значення коефіцієнта термо-е.р.с. та провідності, що слугує однією з умов отримання високих значень термоелектричної добротності.

Результати розрахунку густини електронних станів Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn, виконані на підставі структурних досліджень, підтверджують прогнозовану акцепторну природу структурних дефектів, генерованих у твердому розчині Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn у разі заміщення атомів Нf на Y. Подібні результати отримано під час легування напівпровідника HfNiSn заміщенням атомів Hf атомами Lu, що супроводжується як упорядкуванням структури вихідної сполуки, так і генеруванням структурних дефектів акцепторної природи, які змінюють ступінь компенсації напівпровідникового матеріалу Hf<sub>1-x</sub>Lu<sub>x</sub>NiSn [7, 8]. Дослідження напівпровідникових твердих розчинів HfNi1-xCoxSn та HfNi1-xRhxSn засвідчили, що легування напівпровідника електронного типу провідності n-HfNiSn акцепторними домішками Со чи Rh приводить до зміни типу основних носіїв струму від електронів до дірок [9, 10]. Заміщення атомів Sn у сполуці HfNiSn атомами Sb, які мають на один 5p-електрон більше, ніж атом Sn, приводить до генерування структурних дефектів донорної природи [11]. Дослідження твердого розчину HfNiSn<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub> також засвідчує, що заміна *p*-елемента Sn у структурі HfNiSn значно більше впливає на її стабільність, аніж заміна атомів Нf чи Ni, оскільки система іонно-ковалентних зв'язків утворюється завдяки тетраедричній гібридизації атомних орбіталей Sn і будь-яка суттєва зміна кількості валентних електронів на р-орбіталях приводить до утворення більш енергетично вигідних хімічних зв'язків і, як наслідок, до руйнування структури типу MgAgAs.

Отже, за результатами розрахунку густини електронних станів твердого розчину  $Hf_{1-x}Y_xNiSn$ , виконаних на підставі структурних досліджень, з'ясовано, що заміщення атомів Hf на Y генерує у  $Hf_{1-x}Y_xNiSn$  структурні дефекти акцепторної природи.

Результати електротранспортних досліджень напівпровідникового твердого розчину Hf<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>NiSn дадуть змогу виявити відповідність результатів розрахунків реальним процесам у матеріалі.

- 1. *Ромака В. А., Ромака В. В., Стадник Ю. В.* Інтерметалічні напівпровідники: властивості та застосування. Львів: Вид.-во Львівської політехніки, 2011.
- 2. *Roisnel T., Rodriguez-Carvajal J.* WinPLOTR: a Windows tool for powder diffraction patterns analysis // Mater. Sci. Forum, Proc. EPDIC7. 2001. Vol. 378–381. P. 118–123.
- Schruter M., Ebert H., Akai H. et al. First-principles investigations of atomic disorder effects on magnetic and structural instabilities in transition-metal alloys // Phys. Rev. B. 1995. Vol. 52. P. 188–209.
- 4. *Moruzzi V. L., Janak J. F., Williams A. R.* Calculated electronic properties of metals. NY: Pergamon Press, 1978.
- 5. *Romaka V. V., Rogl P., Romaka L.* et al. Peculiarites of Structural disorder in Zr- and Hf-Containing Heusler and Half-heusler Stannides // Intermetallics. 2013. Vol. 35. P. 45–52.
- Cutler M, Mott N. F. Observation of Anderson localization in an electron gas // Phys. Rev. 1969. Vol. 181. P. 1336–1340.
- 7. *Ромака В. А., Рогль П., Стадник Ю. В., Ромака Л. П.*, та ін. Структурні, енергетичні та кінетичні характеристики термоелектричного матеріалу Hf<sub>1-x</sub>Lu<sub>x</sub>NiSn // Термоелектрика. 2014. № 2. С. 42–52.
- Romaka V. A., Rogl P., Romaka V. V. et al. Features of the band structure and conduction mechanisms of n-HfNiSn semiconductor heavily Lu-doped // Semicond. Vol. 49. 2015. P. 290–297.
- Ромака В. В., Стадник Ю., Ромака Л. та ін. Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNi<sub>1-x</sub>Rh<sub>x</sub>Sn. І. Кристалічна і електронна структури // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2013. Вип. 54. Ч. 1. С. 122–128.
- Ромака В.В., Стадник Ю., Ромака Л. та ін. Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNi<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Sn. І. Кристалічна та електронна структури // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2015. Вип. 56. Ч. 1. С. 115–121.
- Ромака В. В., Стадник Ю., Ромака Л. та ін. Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNiSn<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>. І. Кристалічна та електронна структури // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2014. Вип. 55. Ч. 1. С. 142–148.

## INVESTIGATION OF THE SEMICONDUCTIVE SOLID SOLUTION $Hf_{1-x}Y_xNiSn$ . I. CRYSTAL AND ELECTRONIC STRUCTURE STUDY

Yu. Stadnyk<sup>1</sup>, L. Romaka<sup>1</sup>, V. V. Romaka<sup>2</sup>, V. Krayovskyy<sup>2</sup>, O. Huk<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ivan Franko Lviv National University, Kyryla & Mephodiya Str., 6, 79005 Lviv, Ukraine

<sup>2</sup>Lviv Polytechnic National University, S. Bandera Str., 12, 79013 Lviv, Ukraine

<sup>3</sup>PAT NVO "Thermoprylad", Naukova Str., 3, 79060 Lviv, Ukraine, e-mail: stadnyk\_yuriy@franko.lviv.ua

Crystal and electronic structures of the  $Hf_{1,x}Y_xNiSn$  semiconductive solid solution were investigated in the concentration region x = 0 - 0.30. The *n*-HfNiSn ternary intermetallic semiconductor (MgAgAs structure type, space group *F*4-3*m*) is doped by the Y impurity and the crystallographic characteristics of the obtained  $Hf_{1,x}Y_xNiSn$  solid solution were determined by X-ray diffraction. The alloys were prepared by arc melting the stoichiometric amounts of the constituent elements, annealed at 1073 K for 720 hours and cold water quenched. The diffraction data were collected at room temperature using Guinier-Huber image plate system powder diffractometer (CuK $\alpha_1$  radiation). The static magnetic susceptibility  $\chi$  was measured by Faraday balance technique at 300 K in the magnetic fields up to 0.1 T. The limit of solubility of Y atoms in the HfNiSn stannide was established using X-ray and microprobe analyses ( $x \approx 0.3$ ). The mechanism of simultaneous generation of structural defects with the acceptor nature was established. The results of modeled crystal and electronic structures are in a good agreement with the results of the magnetic properties of  $Hf_{1,x}Y_xNiSn$  solid solution. The analysis of the possible mechanisms of conduction of the  $Hf_{1,x}Y_xNiSn$  semiconductive solid solution was carried out.

Key words: solid solution, crystal structure, electronic structure, semiconductor.

Стаття надійшла до редколегії 02.11.2015 Прийнята до друку 12.01.2016